

Prediction of Electrical Contact Resistance of Tin or Silver Plating — by Shigeru Sawada, Kaori Shimizu, Shigeki Shimada and Yasuhiro Hattori — For virtual connector designing, it is important to predict contact resistance at a mating point. This study investigated the relationship between contact load and contact resistance in terms of contact shape, plating material and plating thickness. Tin or silver plated copper alloy was used in this study. The contact resistance between an embossment pattern and a flat plate was measured by the four-probe method, while the indentation contact area was examined using an optical microscope. This study consisted of two phases: the analysis of load-contact area relationship by FEM (Finite Element Method), and that of contact area-resistance relationship based on the constriction resistance theory with plated layer. For silver plated samples, which have no oxide films, the experimental results agreed with the theoretical predictions. Meanwhile, the results of tin plated samples, which are covered with oxide films, corresponded to the theoretical predictions at a high load region, in which terminal connectors were practically used. Thus it has become possible to predict a load-contact resistance curve.

Keywords: electrical contact, contact resistance, plating, contact load, contact area

1. 背 景

自動車用ワイヤーハーネス(W/H)は、車両に搭載され た制御用コンピュータや、センサー、アクチュエータ、ラ ンプなどの電装品の電気的なやり取りを担っており、自動 車用コネクタは、W/H同士あるいは、W/Hと電装品とを 電気的に接続させる重要な部品のひとつである。

自動車用コネクタの端子には、錫や金、銀などのめっき を施した銅合金が広く用いられている。図1にコネクタの 嵌合状態における端子断面の一例を示す。メス端子はバネ 構造を有し、このバネの力による機械的な接触により、オ ス端子とメス端子との電気的な接続を実現している。端子 を新規に設計する場合、嵌合時の抵抗値を端子試作前に知 ることは非常に有用であり、そのためには、設計因子であ る接点の接触荷重や形状、めっき種などから電気接点の接 触抵抗を予測することが重要となる。

接点における接触荷重と接触抵抗の関係については、多



くの研究者がさまざまな条件下にて研究を行っている^{(1)~(6)}。 F.Ossartらは、接触荷重3N以下の領域において、有限要素 法を用いた接触解析による接触抵抗の予測を試みている⁽¹⁾。 また、X.Hernotらは、めっきのない銅合金接点において、接 触荷重10Nまでの範囲で接触抵抗との関係を論じている⁽⁴⁾。 これらの研究は、いずれも接触荷重10N以下の領域に焦点 をあてたものである。一方、ハイブリッド自動車や電気自 動車に用いる大電流用端子のニーズが、近年増加している。 これらの端子は従来端子より大型で、10Nを越える接触荷 重となっている。そのため、本研究では、10Nを超える接 触荷重領域で、自動車用コネクタに広く用いられる錫めっ き、および大電流用端子に用いられる銀めっきを施した模 擬接点を用い、接触抵抗の実験値と理論値の比較を行い、 予測手法の検討を行った。

2. 接触抵抗予測手法

電気接点は、表面粗さの影響等により機械的接触で得られる見かけの接触面の中に、電気的通電を担う真実接触面 (A-Spot)が存在するとHolmは提案している⁽⁵⁾。図2に そのモデル図を示す。

ここで、A-Spotにおける接触抵抗は、式(1)に示すよう に、第1項の集中抵抗と第2項の被膜抵抗との和として表 される⁽⁵⁾。



図2 見かけの接触面と真実接触面(A-Spot)のモデル図

$$R_k = \frac{\rho}{2a} + \frac{\rho_f d}{\pi a^2} \qquad (1)$$

ρは、接点材料の抵抗率、aは接触半径、ρfは被膜の抵抗率、dは被膜厚みを示している。10Nを超える荷重領域 においては、第1項の集中抵抗が支配的であることが報告 されているため⁽⁶⁾、本研究においては、第1項の集中抵抗 に着目した。

図2に示すようなA-Spotが複数存在する接点の集中抵抗 は、Holmにより近似式(2)が、提案されている⁽⁷⁾。

$$R_k = \frac{\rho}{2r} + \frac{\rho}{2na} \qquad (2)$$

ここで、rは、見かけの接触面の半径、nはA-Spotの数、 aは、A-Spotの半径である。

また、Greenwood は、式 (2) を修正し、A-Spot間の相 互作用を考慮した接触抵抗近似式 (3) を発表している⁽⁸⁾。

ここで、 S_{ij} は、A-Spot間の距離、 a_i , a_j はそれぞれのA-Spotの半径を示している。図3に、A-Spotの半径を変化 させて見かけの接触面積に対する真実接触面積比を変えた 時の式(2)、(3)から得られた接触抵抗値を示した。縦軸は、 真実接触面積の割合が100%、すなわち見かけの接触面積 がすべてA-Spotである時の集中抵抗と、 R_k との比を示す。 真実接触面積の割合が、20%以上あれば、見かけの接触面 がすべてA-Spotである場合に比べ、接触抵抗の増分は、 14~25%程度に留まる結果となる。

そこで今回の研究では、まず見かけの接触面積から得られる接触抵抗は、真実接触面積の接触抵抗とほぼ等しいと 仮定し、式(2)の第1項にのみ着目した式(4)を用いた。

$$R_k = \frac{\rho}{2r} \qquad \dots \qquad (4)$$

接触抵抗の予測の検討は、まず接点形状と接触荷重から 見かけの接触面積を求める「機械的接触」と、次いで接触 面積から接触抵抗を求める「電気的接続」の二つに分離し て行った。



図3 真実接触面積の割合と接触抵抗比との関係

3. 実験方法および結果

錫めっき、銀めっきを施した銅合金材料および、比較用 としてめっきのないサンプルを準備した(**表1**)。

めっき材	めっき厚み (µm)	エンボス径 (mm)
錫	1	1
	3	1
	5	1
銀	2	3
	6	3
めっきなし	—	1, 3

表1 サンプル仕様

端子構造を模擬したサンプルの形状を図4に示す。メス 端子とオス端子の接触を模擬するため、サンプルには、半 径1mm,3mmのエンボス加工を施し、エンボスと平板と の接触での各荷重での接触抵抗の測定を4端子法にて行っ た⁽⁹⁾。図5に実験に用いた装置の概略図を示す。大電流端 子での適用条件を想定し、通電電流を1A、最大荷重を





図4 サンプル形状



図5 測定装置模式図

40N として測定を行なった。各荷重における接触面積は、 光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡 (SEM) により観察し、 圧痕部分を見かけの接触面積とした。ただし、めっきのな い銅合金サンプルでは、圧痕が直接観察できないため、銅 合金サンプルを硫化処理し、薄くやわらかい硫化膜をつけ ることで、接触面積の測定を実施した。

図6に、銀めっき6µmと錫めっき5µmで測定した接触 抵抗の接触荷重依存性を示す。接触抵抗は荷重が高くなる と減少し、また、銀めっきを施すことにより、錫めっきの 場合より接触抵抗値が低くなることが認められる。図7に、 SEMにて接触痕を観察した例を示す。接触点の内部は全面



図6 接触抵抗と荷重の関係例



図7 錫めっき1µm,荷重40Nでの接触痕



図8 荷重と接触面積の関係

に渡って表面が荒れており、接触の境界面がはっきりと観 察されている。図8に、錫めっきおよび、めっきなしのサ ンプルでの接触面積の荷重依存性を示す。錫めっきをした ものは、めっきのないサンプルに比べて接触面積が大きく なっており、このことから接触面積は、めっきによる影響 を大きく受けていることが認められる。

4. 荷重と面積の関係(機械的接触)

エンボスと平板との接触を考える場合、まず、弾性接触 と塑性接触の2つの場合について考える必要がある。球と 平面との弾性接触における接触面積Sについては、ヘルツ により式(5)が示されている⁽⁹⁾。

$$S = \pi \left(\frac{2FR}{2} \left(\frac{1 - v^2}{E}\right)\right)^{\frac{2}{3}}$$
 (5)

ここで、Eは、材料のヤング率、Rはエンボスの半径、F は接触荷重、 ν は、ポアソン比を示す。一方、塑性変形の 場合での接触面積は、**式**(6)に表される。

$$S = \frac{F}{Hv} \tag{6}$$

ここで、Hvは、材料のビッカース硬度である。図9に めっきなし銅合金の場合での荷重と接触面積の実験結果 と、式(5)および式(6)の計算結果との比較を示す。

実験結果は弾性変形の計算値とほぼ合致しており、めっ きがない場合での荷重と接触面積の関係は、弾性接触とな ることがわかる。一方、表面にめっきがある場合は、ヘル ツ式からの乖離が生じるため⁽⁰⁾、FEMによる弾塑性接触解 析を試みた。図10に解析に用いためっき層つきの2次元軸 対称モデル図を示し、また、解析に用いた物性値を表2に 示す⁽¹⁾。一般にめっきは、バルクとは硬さが異なるため、 めっきのひずみ-応力曲線は、バルクのひずみ-応力曲線と は異なる。本研究での錫めっきの硬度は、Hv24とバルク のHv6と異なったため、錫めっきの降伏応力 σyを、式(7)



図9 めっきなし銅合金での荷重と接触面積の関係



図10 2次元軸対称解析モデル図

	材料名	降伏応力 (MPa)	ヤング率 (GPa)	ポアソン比
	銅合金	485	126	0.34
	錫めっき	81	46	0.34
	銀めっき	21	75	0.34

表2 材料物性表

を用いて算出し、ひずみ-応力曲線の補正を行った⁽¹²⁾。

 $H_V = 2.9 \sigma_y$ (7)

一方、銀のような延性の高い材料に対しては、平野らに よる式(8)を用いて、降伏応力 σ_y を算出しひずみ–応力曲 線の補正を行った⁽³⁾。

 $H_{V} = X \sigma_{y} + Y \qquad (8)$ $X = 2.701, Y = 123 - 1.81 \times 10^{-4} A^{2} + (4.499n^{2} - 5.88n + 2.525) A$

以上の条件で解析した結果と実験結果との比較を図11、 12に示す。図11は、錫めっき層がある場合での計算結果 と実験結果との比較を示す。錫めっき層の物性値をHv6 であるバルク材を用いた場合の計算結果も参考まで示し た。錫のバルク材を用いた計算結果は、実測値よりも大き



図11 錫めっきでの解析と実験結果との比較



な値を示し、錫めっきの硬さを実測したものから算出した 計算結果は、実験結果と一致している。このことから、錫 めっき層の硬度が接触面積に大きく影響することがわか る。図12は、銀めっきの場合での例を示す。この場合も、 計算結果と実験値はよく一致している。以上の結果により、 めっきの応力ひずみ曲線を実際のめっきの硬さから推測す ることで、荷重に対する接触面積をFEMによる弾塑性接 触解析で求められることが確認された。また、硬い銅合金 上にやわらかい錫、銀めっきが施されている場合、下地の 銅合金の弾性変形と、最表面のめっきの塑性変形が複合し た弾塑性変形挙動となることが明らかとなった。

5. 接触面積と抵抗の関係(電気的接続)

図13に、各条件における接触面積と接触抵抗の関係の 実験結果を示す。図中、実線は、錫、銅合金、銀それぞれ の材料の固有抵抗率ρ、接触面積Sから、式(4)を用いて 得られた計算結果である⁽⁹⁾。接触面積が大きくなると接触



図13 接触抵抗と接触面積の関係

抵抗は減少し、また、導電率の高い銀めっきは、めっきな し銅合金に比べて接触抵抗が低く、逆に、導電率の低い錫 めっきは、接触抵抗が高くなっている。以上のことから、 めっき種、および、めっき厚みにより接触抵抗が影響を受 けることがわかる。

このめっき層のある場合での集中抵抗の変化について は、谷井らにより式(9)に示す数学解が報告されている⁽⁴⁾。 めっき層のある集中抵抗は、めっきのない集中抵抗の値に、 表面抵抗係数 Φ を掛けた形で与えられ、表面抵抗係数は、 めっき層の厚み、接触半径、めっき、母材の導電率の4つ の変数により決定される(式(9)~(12))。

 $R_{k} = \Phi \frac{\rho_{1}}{2a} \qquad (9)$ $\Phi : 表面抵抗係数$ $\rho_{1} : 母材の抵抗率$ $\Phi = \frac{(1-K)}{(1+K)} \cdot \frac{1}{1+\sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n} K^{n} F(2nd)} \qquad (10)$ $K = \frac{\sigma_{2} - \sigma_{1}}{\sigma_{2} + \sigma_{1}} \qquad (11)$ $\sigma_{1} : 母材の導電率$ $\sigma_{2} : めっき層の導電率$ $d : \quad めっき層厚み$ $F(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-kx} J_{1}(\lambda a) \sin(\lambda a) \lambda \cdot d\lambda \qquad (12)$

J₁:1次のBessel 関数

この表面抵抗係数Φと、めっき厚みとの関係を図14に 示す。横軸は、めっき厚みを接触半径で割った値で、縦軸 が表面抵抗係数となる。図14は、それぞれのKの値に対 する、Φの変化を示している。本研究では、錫めっきのK の値は、-0.445、銀めっきでは、+0.504であった。また、d/aは、0.01から0.2の範囲となった。

ここで、めっき層がある場合の集中抵抗の式(9)の理解 を深めるため、ラプラス方程式による静電場解析を行った。 その結果を図15、16に示す⁽⁵⁾。図15は、めっきのない接 点に流れる電流線と等電位線の変化を示している。接点に







図15 めっきがない接点における電流線と、等電位分布図



-(40)- 錫及び銀めっき電気接点の接触抵抗予測

向かって電流線が集中し、等電位線が接点を中心に楕円状 となっている。一方、表面に接点材料とは異なった導電率 のめっき層がある場合の電流線の変化と等電位線の変化を 図16に示す。低い導電率のめっきを施した場合、めっき 層界面にて電流は接点の外側に向かい、また、高い導電率 のめっきを施した場合は、接点の内側に向かって電流線が 屈折している。その結果、より高い導電率のめっきを施す と接点中央部分に電流がより流れるようになり、接触抵抗 が下がることになる。

次に、銀めっき2µm, 6µm、錫めっき1µm, 5µmの場合 について、図14より得られる集中抵抗の理論値とそれぞ れの実験値との比較を図17に示す。酸化被膜のない銀 めっきの場合、計算結果と実験値はよく一致しており、一 方、酸化被膜のある錫めっきについても、計算結果に対し て実験値がほぼ一致している。

6. 接触荷重と接触抵抗の関係

図11、12より、接触荷重と接触面積の関係が得られ、 図17より、接触面積と接触抵抗の関係が得られたことか ら、両者を組み合わせることにより、接触荷重に対する接







触抵抗の予測を試みた。めっきのない場合でのエンボス半 径 1mm および 3mm の接触抵抗の実験値と予測値との比 較を図18に、銀めっき厚みが 2µm, 6µm の場合を図19に、 錫めっきの場合を図20にそれぞれ示す。それぞれの図中、 点が実験結果を示し、実線が解析から求めた予測値を示す。 試験直前に酸化被膜除去を行っためっきなし銅合金の場合 及び、酸化被膜のない銀めっきについては、実験結果と予 測結果がよく一致している。また、酸化被膜のある錫めっ きについては、集中抵抗が支配する領域において、実験結 果と予測結果が一致している。

本実験では、図7に示すように圧痕は全面に荒れがみら れ多くのA-Spotが存在することから、真実接触面積の割 合は、みかけ面積に対して十分に存在すると推定される。 そのため、FEM接触解析で求められる見かけの接触面積か ら求めた接触抵抗が、実験結果と一致したと推定される。 以上のことから、接触荷重が高く、真実接触面積の割合が 多く存在する場合、FEM解析で求めた見掛けの接触面積は、 電気的通電での真実接触面積と考えて接触抵抗を計算して も実用上の問題は少ない。

7. まとめ

錫および銀めっきにおける接触抵抗の荷重依存性につい て解析を行なった結果、以下のことが明らかとなった。

- 1. 接触荷重と接触面積の関係は、めっきの物性を考慮 した弾塑性FEM解析により求めることができる。
- 接触面積と接触抵抗の関係は、めっき層を考慮した 集中抵抗の式を用いることで、算出可能である。
- 3. 各荷重での接触抵抗は、1.及び2.を組み合わせることで、予測することが可能である。
- 酸化被膜のない銀めっきでは、実験結果と予測値が よく一致した。また、表面に酸化被膜のある錫めっ きにおいては、集中抵抗が支配的となる荷重領域に て、予測値と実測値が一致した。
- 5. 接触荷重が高く、真実接触面積の割合が多い場合で は、FEM解析で求めた見掛けの接触面積は、電気的 通電での真実接触面積と考えて接触抵抗を計算して も実用上の問題は少ない。

参考文献

- F. Ossart, S. Noel, D. Alamarguy, S. Correia and P. Gendre, "Electromechanical modelling of multilayer contacts in electrical connectors", Proc. IEEE Holm Conf. Electro Contacts 53th, pp.1-8 (2007)
- (2) J. L. Queffelec, N. Ben Jemaa, D. Travers and G. Pethieu, "MATERIALS AND CONTACT SHAPE STUDIES FOR AUTOMOBILE CONNECTOR DEVELOPMENT", Proc. IEEE Holm Conf Electr Contacts 36th, pp.225-231 (1990)
- (3) 塚本真史、佐野一仁、藤巻裕彦、「基礎モデル実験による接触抵抗メ カニズムの検討」、矢崎技術リポート、Vol.20, pp.76-79 (1996)
- (4) X. Hernot, A. Senouci, A. El Manfalouti and N. Ben Jema, "Contact Resistance law for elasto-plastic domains in the force range (1mN-10N)", IEICE Technical Report, EMD2002-57, pp. 10-13 (2002)
- (5) R. Holm, "Electric Contacts theory and application", Springer-Verlag NewYork Inc. (1967)
- (6) Y. Saitoh, K. Iida, S. Sawada, K. Shimizu and Hattori, "Dependency of Contact Resistance on Load", Proc. of IEEE Holm conf., pp.70-75 (2007)
- (7) R.Holm, "Constriction resistance of an assembly of elongated aspots", Proc. of ICEC, p.16, May (1970)
- (8) J.A.Greenwood, "Constriction resistance and real area of contact," Brit. J. Appl. Phys., Vol.17, pp.162-1632 (1966)
- (9) S. Sawada, K.Shimizu, Y. Hattori, Y. Saito, T. Tamai and K. Iida, "The effect of plating and contact shape of contact resistance in electric contact", Proc. International Confernce of Electrical Contacts 24th, pp.257-261 (2008)
- (10) K. Shimizu, S. Shimada, S. Sawada and Y. Hattori, "Prediction of resistance of electrical contact with plated layer (2) -Contact area by FEM analysis -". IEICE Technical Report, EMD2008-89 ,pp.97-100 (2008-11)
- (11) K. Shimizu, S. Shimada, S. Sawada and Y. Hattori, "Contact area analysis by FEM with plating layer for electrical contact", IEICE Trans. Electron. Vol.E92-C, no.8, pp.1013-1019, Aug. (2009)
- (12) D. Tabor, The Hardness of Metals, Oxford (1951, 2000 republish)
- (13) 平野明彦、坂根政男、濱田直巳、「ビッカース硬さに及ぼす非弾性材 料定数の影響について」、材料力学部門講演会講演論文集、Vol.2004、 pp.583-584 (2004)
- (14) 谷井琢也、「小形クロスバスイッチの通話路接点」、電電公社研究実用 化報告、NTT Vol.15、No.5 pp. 760-791 (1966)
- (I5) S. Sawada, K. Shimizu, Y. Hattori and T. Tamai, "Prediction of resistance of electrical contact with plated layer (1) -Theoretical analysis -". IEICE Technical Report, EMD2008-88, pp.93-96 (2008-11)



*主執筆者